

用分光光度计测量核靶厚度和均匀性

@许国基\$中国原子能科学研究院!北京 @孟祥金\$中国原子能科学研究院!北京 @罗兴华\$中国原子能科学研究院!北京

收稿日期 1986-11-25 修回日期 网络版发布日期:

摘要 文章叙述了吸光光度法测量核靶厚度和均匀性的一般原理,并给出碳膜和金属膜的具体测量方法,本方法的厚度测量范围为5—200 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$,测量精度为10%。

关键词 [分光光度计](#) [碳剥离膜](#)

分类号

THE THICKNESS MEASUREMENTS OF TARGETS WITH SPECTROPHOTOMETER

XU GUOJI; MENG XIANGJIN; LUO XINGHUA Institute of Atomic Energy, P. O. Box 275, Beijing

Abstract A method for measuring the thickness of thin targets with a spectrophotometer is described. The principle of the method and the instrument used are mentioned. The relation between thickness and absorption for carbon, gold and copper foils are given.

Key words [Spectrophotometer](#) [Carbon stripper foil](#)

DOI

通讯作者

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [\[PDF全文\]\(287KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“分光光度计”的相关文章](#)

▶ [本文作者相关文章](#)